. Searching PAJ

10/18/2004 16:54

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

09-005764

(43) Date of publication of application: 10.01.1997

(51)Int.Cl. ·

G02F 1/1343 G02F 1/136

H01L 29/786

(21)Application number: 07-152849

(22)Date of filing: 20.06.1995

(71)Applicant : HITACHI LTD

(72)Inventor: OGAWA KAZUHIRO

OTA MASUYUKI

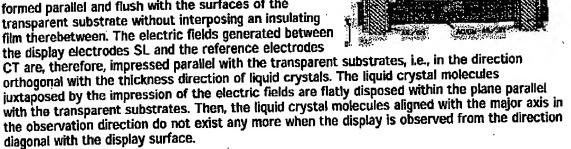
YANAGAWA KAZUHIKO ASHIZAWA KEIICHIRO YANAI MASAHIRO

(54) LIQUID CRYSTAL DISPLAY SUBSTRATE

(57) Abstract:

PURPOSE: To improve a wide visual field angle characteristic by forming electrodes for display and reference electrodes within the same plane parallel with transparent substrates and changing the light transmittance of a liquid crystal layer by the electric fields generated in parallel with the transparent substrates between both electrodes.

substrates between both electrodes.
CONSTITUTION: The display electrodes SL and reference electrodes CT of the liquid crystal display substrate having the display electrodes SL and the reference electrodes CT on the liquid crystal layer side surface of the one transparent substrate of the transparent substrates arranged opposite to each other via the liquid crystal layer are directly formed on the main surface of the transparent substrate and are formed parallel and flush with the surfaces of the transparent substrate without interposing an insulating film therebetween. The electric fields generated between



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]
[Date of sending the examiner's decision of rejection]

(Kind of final disposal of application other than

페이지 2 / 2

Searching PAJ

the examiner's decision of rejection or application converted registration]
[Date of final disposal for application]
[Patent number]
[Date of registration]
[Number of appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

10/18/2004 16:54

四公開特許公報(A)

(11)特許出願公閱番号 特開平9-5764

(43)公開日 平成9年(1997)1月10日

(51) Int.CL.*		以明显号	庁内整理番号	FI	1/1343		1	技術表示個所
• • • •	/1343			G 0 2 F	1/1343	500	`	
_	1/136 9/786	500		H01L 2	1/130	6120	3	•
				審查胡求	未結束	請求項の数13	ΟL	(全 10 頁)
(21) 出顧番号 特別		翼平7-152849	7 – 152849			000005108 株式会社日立製作所		
(22)出顧日 平成7年(1995) 6月20日 東京都千代田区神田駿河台							可台四	丁目6番地

(72)発明者 小川 和宏 千葉県茂原市早野3300番地 株式会社日立 製作所電子デバイス事業部内

MCKENNA, LONG, ALDRG

(72) 発明者 太田 益幸 千葉県茂原市早野3300番地 株式会社日立 製作所電子デバイス事業部内

(72) 発明者 柳川 和彦 千葉県茂原市早野3300番地 株式会社日立 製作所電子デバイス事業部内 (74)代理人 弁理士 秋田 収音

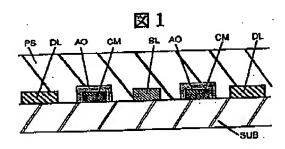
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 被品表示基板

(57)【要約】

[目的] その広視野角特性のさらなる向上を図る。

【構成】 液晶層を介して互いに対向して配置される透 明基板のうち、その一方の液晶層側の面に表示用電極と 基準電極とが備えられ、これら表示用電極と基準電極の 間に透明基板面と平行に発生させる電界によって前記液 晶層の光透過率を変化させる液晶表示基板において、前 記表示用電極と基準電極はそれぞれ前記透明基板に対し て平行な同一面内に形成されている。



(2)

特開平日-5764

【特許請求の範囲】

【語求項】】 液晶層を介して互いに対向して配置される透明基板のうち、その一方の液晶層側の面に表示用電極と基準電極とが備えられ、これら表示用電極と基準電極の間に透明基板面と平行に発生させる電界によって前記液晶度の光透過率を変化させる液晶表示基板において

前記表示用電極と基準電極はそれぞれ前記透明基板に対 して平行な同一面内に形成されているととを特徴とする 液晶表示基板。

【請求項2】 表示用電極と基準電極はそれぞれ選明基板に対して他の材料層を介在させることなく直接に形成されていることを特徴とする請求項1記載の液晶表示基板。

【請求項3】 透明基板上に形成された基準電極はその 材料の酸化によって形成された絶縁膜によって被覆され ていることを特徴とする請求項1記載の液晶表示基板。

【請求項4】 透明基板上に形成された基準電極はその 表面において陽極化成によって酸化された絶縁膜が形成 されていることを特徴とする請求項3記載の液品表示基 20 版

【請求項5】 基準電極の材料はアルミニュウムあるいはその合金からなる請求項4記載の液晶表示基板。

【請求項6】 基準電極の材料はタンタルあるいはその 合金からなる請求項4記載の液晶表示基板。

【請求項7】 液晶層を介して互いに対向して配置される透明基板のうち、その一方の液晶層側の面に x 方向に延在しかつ y 方向に並設される走査信号根および基準信号線と、 y 方向に延在しかつ x 方向に並設される映像信号線と、 前記走査信号線からの走査信号の供給によってオンされる薄膜トランジスタと、 このオンされた薄膜トランジスタを介して前記映像信号線からの映像信号が供給される表示用電極と、 この表示用電極と対向しかつ前記基準信号線と接続されて形成される基準電極とが備えられ、 これら表示用電極と基準電極の間に透明基板面と平行に発生させる電界によって前記液晶層の光透過率を変化させる液晶表示装置において、

前記表示用電極と基準電極はそれぞれ前記透明基板に対して平行な同一面内に形成されていることを特徴とする 液品表示基板。

【請求項8】 走査信号線、表示用電極、および基準電極はそれぞれ透明基板に対して他の材料層を介在させる ととなく直接に形成されていることを特徴とする請求項 7記載の液品表示基板。

【請求項9】 透明基板上に形成された走査信号線および基準電極はその材料の酸化によって形成された絶縁膜によって被覆されていることを特徴とする請求項7記載の液晶表示基板。

【諸求項10】透明基板上に形成された走査信号線およ よって前記液晶層の光透過率を変化させる液晶表示基故び基準電極はその表面において陽極化成によって酸化さ 50 において、前記表示用電極と基準電極はそれぞれ前記透

れた絶縁膜が形成されていることを特徴とする諸求項9 記載の液晶表示基板。

(請求項11) 走査信号線および基準電極の材料はアルミニュウムあるいはその合金からなる請求項10記載の液晶表示基板。

【請求項12】 走査信号線および基準電極の材料はタンタルあるいはその合金からなる請求項10記載の液晶表示基板。

【請求項13】 走査信号線および基準信号線に対する 映像信号線の層間絶縁およびこの層間絶縁線の延在部と して形成され薄膜トランジスタの形成領域となる部分を 構成する絶縁層および半導体層の顧次積層体は同一バタ 一ンの順次積層体からなっていることを特徴とする請求 項8記載の液晶表示基板。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、液晶表示基板に係り、いわゆる横電界方式と称される液晶表示基板に関する。 【0002】

「従来の技術」いわゆる極電界方式と称される液晶表示 基板は、液晶層を介して互いに対向して配置される透明 基板のうち、その一方の液晶層側の面に表示用電極と基準電極の間 地電極とが備えられ、これら表示用電極と基準電極の間 に透明基板面と平行に発生させる電界によって前記液晶 層の光透過率を変化させる液晶表示基板をいう。

【0003】とのような構成からなる液晶表示基板は、その表示面に対して斜めの方向から該表示面を観察しても階調反転や色変化が起とらず、画質が殆ど劣化するととのない、いわゆる広視野角特性を有するものとなっている。

[0004]

30

4Ω

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、このように構成された液晶表示基板は、たとえば、液晶層にその厚み方向に電界を発生させて該液晶層の光透過率を変化させるものと比較して、大幅な広視野角特性の向上を達成できるものとなっているが、いまだに一定の視野角内に制限されるものであった。

【0005】本発明は、とのような事情に基づいてなされたものであり、その目的は、広視野角特性のさらなる向上を図った液晶表示基板を提供するととにある。

[0006]

【課題を解決するための手段】本順において開示される 発明のうち、代表的なものの概要を簡単に説明すれば、 以下のとおりである。

【0007】すなわち、液晶層を介して互いに対向して配置される透明基板のうち、その一方の液晶層側の面に表示用電極と基準常極とが備えられ、これら表示用電極と基準電極の間に透明基板面と平行に発生させる電界によって前記液晶層の光透過率を変化させる液晶表示基板において、前記表示用電極と基準電極はそれぞれ前記透

特開平9-5764

(3)

30

明基板に対して平行な同一面内に形成されていることを 特徴とするものである。

[0008]

【作用】とのように構成された液晶表示基板において、 表示用電極と基準電極はそれぞれ前記透明基板に対して 平行な同一面内に形成されており、それらの間には透明 基板に対する高低差のないものとなっている。

【0009】とのため、画紫電極と基準電極との間に発 生させる電界は、透明基板に対して平行に、すなわち液 晶に対しその厚み方向と完全に直交する方向に印加され 10 るととになる。

【00】0】このことは、電界が印加されることによっ て並設される液晶分子は、透明基板に対して平行な面内 で並設され、酸面に対して傾斜して存在するようなこと はなくなる。

【0011】したがって、表示面に対して斜めの方向か **ら該表示面を観察した場合に、その観察する方向に長軸** が一致づけられる液晶分子が全く存在しなくなる。

[0012] そして、このような状態は観察する方向を かなり傾けても回様であって全く変わることはないこと 20 から、広視野角特性の大幅な向上を図ることができるよ うになる。

[0013]

【突旋例】以下、本発明による液晶表示基板の実施例に ついて説明する。

【0014】〔実施例I〕

基板構成

まず、図11は、本発明による液晶表示基板が組み込ま れた液晶表示装置の一実施例を示す機略構成図である。

【0015】同図において、液晶表示基板100があ る。この液晶表示基板100は液晶を介して互いに対向 配置された2枚の透明基板を備え、その一方の透明基板 SUBの液晶側の面には図中y方向に延在しかつx方向 に並設された映像信号線DLが形成され、また、この映 像信号線DLに絶縁されてx方向に延在しかつy方向に 並設された走査信号線GLが形成されている。

【0016】とれら映像信号線DLおよび走査信号線G **しに囲まれた各矩形の領域が画素領域を構成するように** なるが、この液晶表示基板は上述したようにいわゆる横 電界方式のものであることから、上述した各信号線の他 40 に基準信号線CMも形成されている。

【0017】すなわち、この基準信号線CMは図中×方 向に延在しかつッ方向に並設されて形成され、各画素領 域においてはその画素を間にして対応する走査信号線G しと平行に形成されるようになっている。

【0018】との各画素領域の詳細な構成は後に図2等 を用いて説明する。

【0019】そして、この液晶表示基板100の周囲に は、走査信号線GLに接続されて配置される垂底走査回 路101、および映像信号線DLに接続されて配置され 50 る)を介してその上層のアモルファスシリコンa-Si

る映像信号駆動回路102が配置されている。これら垂 直走査回路100および映像信号駆動回路102はたと えばテープキャリア方式で形成された半導体装置等から なっているものである。

【0020】前記垂直走査回路101は、各走査信号線・ GLに走査信号を印加することによって該信号線をソ方 向にたとえば順次選択し、その選択のタイミングに合わ せて前記映像信号駆動回路102は各映像信号線DLに 映像信号を供給している。

【0021】それぞれの信号の供給は表示情報処理回路・ 103によって制御されるようになっており、この表示 信号処理回路 103は、クロック回路 14を介して垂直 走査回路101を駆動させるとともに、映像信号駆動回 路103を駆動させるようになっている。

(0022)また、表示信号処理回路103は、液晶表 示基板 100の前記基準借号線CMのそれぞれに基準電 圧を直接印加するようになっている。

[0023] 図2は、前記液晶表示基板100の各画素 領域のうちの一つの画素領域を示した平面図である。

【0024】同図において、画素領域は、図中x方向に 延在する走査信号線AO/GLおよび基準信号線AO/・ CMと、y方向に延在しかつx方向に並設する各映像信 号線DLとで囲まれて形成されている。

【0025】ととで、走査信号線AO/GLおよび基準 信号線AO/CMは、その材料としてそれぞれアルミニ ュウム (A 1) が用いられているとともに、その露出す る表面全域(側面を含む)にいわゆる陽極化成による酸 化アルミニュウムAOが形成されたものとなっている。· また、映像信号線DLは、クロム(Cr)層で形成され ている.

【0028】映像信号線DLは、その下層の走査信号線 AO/GLおよび基準信号線AO/CMに対して、その 交差部において形成されたシリコン窒化膜SiNxとア モルファスシリコンa-Siとの樋層体AS/SNから なる層間絶縁膜を介して絶縁されるようになっている。 【0027】そして、これら各層間絶縁膜のうちの一つ (図中、左上の層間絶縁膜)は、走査信号線AO/Gし 上を画素領域側に及んで延在され、との延在領域は薄膜 トランジスタTFTの形成領域を構成している。

【0028】すなわち、との薄膜トランジスタTFTの 形成領域において、映像信号線DLから前記積層体AS /SN上を延在して形成されたドレイン電極DTとこの ドレイン電板DTに若干離間されて形成されたソース電 極STを備えるととによって、前記走査信号線AO/G Lの一部をゲート電極とした稼膜トランジスタTFTが 形成されている。

【0029】これにより、走査信号線AO/GLに走査 信号 (電圧) が供給された場合、積層体AS/SNの下 層にあるシリコン窒化膜(ゲート絶繰膜として機能す

層内にチャネル層が形成され、映像信号線DLからの映 像信号は前記ドレイン電極DTを介してソース電観ST に供給されるようになる。

[0030]そして、ソース電板STは表示電極SLと 一体に形成されており、この表示電極SLは、画素領域 を略2分するようにして図中ッ方向に延在して配置され ている。なお、との実施例において、前記表示電極SL は映像信号線DLと同一の材料、すなわちクロム(C 1) によって構成されている。

【0031】また、基準信号線AO/CMはその一部を 10 図中y方向に延在させて形成された基準電板CTを2個 備え、それぞれの基準電極は前記表示電極SLを間にし かつこの表示電価SLと比較的大きな距離を隔てて配置 されているとともに、映像信号線DLとはかなり近接さ れた状態で配置されている。

【0032】との場合、基準電極CTは、上述したよう にその表面において酸化アルミニュウムからなる絶縁膜 が形成されていることから、電気的短絡を生ぜしめるこ となく映像信号線DLに近接させることができ、いわゆ る関口率を向上させることができるようになる。

【0033】そして、このように構成された表示電極S Lと基準電極CTとの間に透明基板100Aの主表面と ほぼ平行な電界が発生する構成となる。すなわち、この 電界によって液晶の紙面と垂直方向における光透過率を 変化させることができるようになり、この方式が樹電界 方式と称される所以となっている。

【0034】本実施例では、1画素は表示電極SLを1 側、基準電極を2個により構成したが、各々2,3個、 さらには3.4個にしても良い。

[0035]ととで、表示電極と基準電極CTは、それ 30 らの間に絶縁膜を介在しておらず、透明基板SUBの主 表面上に直接形成され、透明基板SUBの表面と平行な 間一面に形成されている。

【0036】とのため、画素電極と基準電極との間に発 生させる電界は、透明基板に対して完全に平行に、すな わち液晶に対しその厚み方向と完全に直交する方向に印 加されることになる。

【0037】このことは、電界が印加されることによっ て並設される液晶分子は、透明基板に対して平行な面内 はなくなる.

[0038] したがって、表示面に対して斜めの方向か ら該表示面を観察した場合に、その観察する方向に長軸 が一致づけられる液晶分子が全く存在しなくなる。

【0039】そして、とのような状態は観察する方向を かなり傾けても同様であって全く変わることはないこと から、広視野角特性の大幅な向上を図ることができるよ うになる。

[0040]なお、表示電価SLのソース電極SLとは 反対側における端部は基準信号線AO/CMと銀畳され 50 ような工夫を要することのない様成となっている。

て形成され、この重量部において積極的に付加容量C 57.を構成するようになっている。 この場合の誘電体膜 は基準信号線AO/CMの表面に形成されている酸化ア ルミニュウムAOである。

【0041】とのように、付加容量C,,,の誘電体は比 較的膜厚の小さな酸化アルミニュウムAOで構成される ととから、その面積を大きくしなくても大きな容量を確 保できるという効果を奏するようになる。

【0042】なお、この付加容量は、たとえば薄膜トラ ンジスタ丁FTがオフした後の映像情報を次の選択時間 まで保持させる等の目的で形成されているものである。 【0043】そして、図示していないが、このように様 成された透明基板の主表面には前記映像信号線DL等を 全て寝ってシリコン窒化膜からなるパッシベーション膜 PSが形成されている。

【0044】図1は、図2のA-A^{*} 線における断面図 を示した構成図である。同図から明らかとなるように、 映像信号線DL、表示電弧SL、および基準電極CM は、それぞれ透明基板SUBの主表面に直接形成された 20 ものとなっている。

[0045]図6は、透明基板SUBの周辺にまで延在 される走査信号線GLが、前記垂直走査回路101の端 子と接続されるべく個所となる電極端子10の部分の構 成を示した断面図である。

【0046】同図において、走査信号線GLの末端部に おいては、その表面に酸化アルミニュウムAOが形成さ れておらず、とれにより蕗呈されているアルミニュウム 層の一部に前記電極端子10となるITO(Indium-Tin -Oxide) 膜が形成されている。

【0047】そして、いまだ露呈されているアルミニュ ウム層および前記!TO膜の一部を覆って映像信号線 D Lと同材料からなる導電層20が形成されている。

【0048】この導電層20は、映像信号線Dしとは電 気的には全く独立して形成されるものであり、走査信号 線GLと「TO膜からなる電極端子10とのコンタクト に信頼性をもたせる機能を有するようになっている。 す なわち、アルミニュウムからなる走査信号線GLとIT O膜との接触のみでは、ITO膜とアルミニュウムとの 界面に絶縁性の酸化アルミニュウム膜を形成してしまい で拡設され、铍面に対して傾斜して存在するようなとと 40 抵抗値のバラッキを生じさせるのを防止するようにして いる。

> 【QQ49】図7は、透明基板SUBの周辺ににまで延 在される映像信号線DLが、前記映像信号駆動回路10 2の端子と接続されるべく個所となる電極端子10の部 分の構成を示した断面図である。

> 【0050】この場合、映像信号線DLの末端部におい て電極端子10となる1丁〇膜の一部が重畳されて形成 されているのみとなっている。映像信号線DLが酸化し 難い材料で構成されていることから、特に、図8に示す

(5)

特開平9-5764

【0051】図3は、上述のように構成された透明基板 が組み込まれた液晶表示基板の断面を示した構成図であ

【0052】同図において、上述した透明基板SUBと は別個の透明基板SUB゜がそれぞれ液晶LCを介して 対向配置されて構成されている。

【0053】透明基板SUB'の液晶側の面には、各画 素領域を縁取るようにして形成されたブラックマトリッ スク層BMが形成され、さらに、これらブラックマトリ ックス層BMに囲まれた画素領域にはカラーフィルタ層 10 CFがその周辺を該ブラックマトリックス層BMに重量 させて形成されている。

【0054】そして、とのようなブラックマトリッスク 層BMおよびカラーフィルタ層CFが形成された透明基 板SUB'の主表面には、これら各層を覆ってシリコン 窒化膜からなるパッシベーション膜PS'が形成されて いる。とのバッシベーション膜PS:は主としてカラー フィルタ層CFを保護するためにある。

[0055]なお、同図には、表示用電極Sしと基準電 の配列状態を示している。

【0058】とのような実施例による液晶表示基板によ れば、表示用電極SLと基準電極CTはそれぞれ前配透 明基板SUBに対して平行な同一面内に形成されてお り、それらの間には透明基板SUBに対する高低差のな いものとなっている。

【0057】このため、表示用電極SLと基準電極CT との間に発生させる電界Eは、透明基板SUBに対して 平行に、すなわち液晶層に対しその厚み方向と完全に直 交する方向に印加されることになる。

【0058】このことは、延昇Eが印加されることによ って並設される液晶(分子)LCは、透明基板SUBに 対して平行な面内で並設され、該面に対して傾斜して存 在するようなととはなくなる。

[0059] したがって、表示面に対して斜めの方向か ら該表示面を観察した場合に、その観察する方向に長軸 が一致づけられる液晶分子が全く存在しなくなる。

【0080】そして、とのような状態は観察する方向を かなり傾けても同様であって全く変わることはないこと から、広視野角特性の大幅な向上を図ることができるよ 40 うになる.

【0061】なお、上述した実施例では、基準電極AO /CMの断面は図1に示したように、ほぼ矩形状をなし ているものであるが、図10に示すように、その長手方 向に沿った辺をいわゆるテーバ加工された台形をなす形 状としてもよいことはいうまでもない。

【〇〇日2】 このようにした場合、パッシベーション膜 PSの形成に当たって、その表面に急激な段差部がなく なり、酸パッシベーション膜PSの表面に形成する配向 **膜OR1のラビング処理を行い易いという効果を奏す**

る.

【0063】また、基準電極AO/CMと同材料からな る走査信号線AO/GLを同様の処理がなされることに よって、その後に交差して形成される映像信号線DLの 段切れによる断線の発生を抑制できるという効果をも奏 せる。

【0064】製造方法

工程1.透明基板SUBの主表面に、その全域にわたっ てアルミニュウム(Al)膜を形成する。その後、周知 のフォトリソグラフィ技術を用いた選択エッチング方法 を用いて選択エッチングし、図4に示すパターンからな るアルミニュウ膜を残存させるとともに、それ以外の領 域のアルミニュウム膜を全て除去する。

【0065】その後、陽極化成により、残存されたアル ミニュウム膜の露呈された表面の全域(側面を含む)に 酸化アルミニュウムを形成する。

【0088】との場合の陽極化成においては、その化成 対象となるアルミニュウム腹に電力を供給する必要があ るが、その供給場子としては図Bに示したように【TO 極CTとの間に発生した電界Eによる液晶(分子)LC 20 膜10および導電膜20に接続されるべく個所を選択す ることができる。

> 【0067】とれにより、透明基板SUBの主表面に、 走査信号線AO/GL および基準信号線AO/CMが形

【0068】 工程2. 透明基板SUBの主表面の全域 に、前記走査信号線AO/GLおよび基準信号線AO/ CMをも覆って、シリコン窒化膜(SiNx)、アモル ファスシリコン膜(a~Sì)、さらには高濃度不純物 層n型S爿層を頑次形成することによって積層体を形成 30 する。この場合の成膜方法としてはいわゆるプラズマC VD法を用いた連続成膜を行なうのが好適となる。

【0069】これにより形成された積層体を周知のフォ トリソグラフィ技術を用いた選択エッチング方法を用い て選択エッチングし、図5に示すパターンからなる積層 体を残存させるとともに、それ以外の領域にある積層体 を全て除去する。この場合の選択エッチングとしては、 SF。を用いたドライエッチング方法を適用させること によって迅速な加工を行なうととができるようになる。 【0070】これにより、前記走査信号線AO/GLも よび基準信号線AO/CMと次の工程で形成される映像 個号線DLとの層間絶縁を図る層間絶縁膜と、とれら層 間絶縁膜のうちの一つの潜間絶縁膜が延在されて一体的 に形成された薄膜トランジスタ形成領域とが形成され

【0071】この場合、前記積層体はそれらを構成する 各層のパターンに相違がなく全く同一のパターンとなっ ていることから、工程数の低減を図る効果を奏する。 [0072]工程3、とのように加工された透明基板S UBの主義面に、その全域にわたってITO膜を形成す 50 る。とれにより形成された1TO膜を周知のフォトリン

(6)

特開平9~5764

グラフィ技術を用いた選択エッチング方法を用いて選択 エッチングし、図6および図7に示す電極端子10を残 存させるとともに、それ以外の領域にあるITO膜を全

【0073】工程4. とのように加工された透明基板S UBの主表面に、その全域にわたってクロム(Cr)膜 を形成する。とれにより形成されたクロム膜を周知のフ *トリソグラフィ技術を用いた選択エッチング方法を用 いて選択エッチングし、図2に示すパターンからなるク ロム膜を残存させるとともに、それ以外の領域にあるク 10 ロム膜を全て除去する。

【0074】とれにより、映像信号線DLおよび表示電 極SLが形成さるととともに、薄膜トランジスタTFT の形成領域において該映像信号線DLと一体的に形成さ れたドレイン電極DTおよび表示電極SLと一体的に形 成されたソース電極STが同時に形成される。

【0075】そして、との場合、図6に示した導電層2 0が、やはり同じ工程で形成されるようになっている。 【0076】工程5. とのように加工された透明基板S UBの主表面に、その全域にわたってシリコン室化膜を 20 たとえばCVD法を用いて形成する。これにより形成さ れたシリコン廃化膜を周知のフォトリソグラフィ技術を 用いた選択エッチング方法により選択エッチングし、電 極端子10のみを露呈させる。

【0077】とれにより、電極端子10の部分が露呈さ れたバッシベーション膜PSが形成されることになる。 【0078】その後は、このパッシベーション膜PSの 主表面の全域に樹脂膜を形成し、その表面をラピングす ることにより配向膜ORIを形成する。

【0078】以上説明した製造方法によれば、フォトリ ソグラフィ技術を用いた選択エッチング方法による選択 エッチングの工程をわずか5工程で済ませることから、 製造工程を低減できるとともに、それによって微細加工 を達成することができる効果を奏する。

【0080】 (実施例11) 図13は、図2に対応した図 ъ.

【0081】同図から明らかになるように、画案電色ら Lは2個に枝分かれして形成され、これにともない、基 ようにして3個設けられている。

【0082】とのようにした場合、画素のいわゆる閉口 領域は小さくなるが、画素電極SLと基準電極CTとを 近接して配置できることから、それらの間に発生する電 界の量を大きくでき、液晶の駆動を行い易くできる。

【0083】図12は、図13のB-B' 線における断 面図を示しており、実施例Iに示した構成と異なるの は、基準電極CTにある(との場合、走査信号線AO/ GLの断面も同様である)。

【0084】すなわち、基準電極CTは、下層導電膜C 50

MDを内在させて積層させたアルミニュウム層からなる 上層導電膜CMUの表面に隔極化成で形成されたアルミ ニュウム酸化膜が被着された構成となっている。との場 合、下層導電膜とアルミニュウム層は、それぞれフォト リソグラフィ技術を用いた選択エッチング方法を適用さ せて形成されるものとなっている。

10

【0085】とのように構成した理由は、基準電弧CT を形成する場合における断線予防対策とするものであ る。すなわち、前記下層導電膜あるいはアルミニュウム 層のいずれかにおいてその製造工程中に断線が生じた状 態で形成されても、その断線個所が全く同じ部分となる 確率は少なく、結果として基準電極CTそれ自体として 断線が生じないものを得ることができるようになる。

【0088】本実施例は、たとえば陽極化成された走査 信号線AO/GLおよび基準電極CTの絶縁耐圧性の優 れていることに若思し、映像信号線DLとの間に介在さ れていた絶縁膜を不要とすることによって、設基準電極 CTと表示用電極SLとを同一の平面内に配置できるよ **うにしたものである。**

【0087】ことで、図8を用いて、アルミニュウム層 を陽極化成するととによって得られる酸化アルミニュウ ムの絶縁耐圧性を説明する。同図は、液晶表示基板に組 み込まれた走査信号線AO/GLにおける絶縁耐圧性に 伴う故障結果について、いわゆるワイブル分布を示すグ ラフである。とのグラフの各プロットの傾きが大きいほ どその信頼性があることが知られている。

【0088】とのととから、酸化アルミニュウムの絶縁 耐圧性が良好なことが判る。

【0089】上述した各実施例では、基準電極CTおよ び走査信号線AO/GLの材料としてアルミニュウムを 用いたものであるが、これに限定されることはなく、た とえばタンタルあるいはその合金であってもよいことは いうまでもない。との場合においても、陽極化成によっ て酸化膜を形成するととができる。

【0090】その絶縁耐圧性については、図8に対応さ せたグラフである図요に示すように、極めて良好である ととが判る。

【0081】さらに、上述した実施例では、陽極化成に よって走査信号線AO/GLおよび基準電極CTの表面 準電極C Tは各画素電極S L をそれぞれ間に位置づける 40 に絶縁膜を形成したものであるが、これに限定されると とはなく、たとえば、プラズマ酸化法を用いても同様の 効果を奏する。

[0092]

【発明の効果】以上説明したととから明らかなように、 本発明による液晶表示基板によれば、その広視野角特性 のさらなる向上を図ることができるようになる。

【図面の簡単な説明】

[図1] 本発明による液晶表示差板を構成する一方の透 明基板の一実施例を示す断面図である。

【図2】本発明による液晶表示基板における画素領域バ

PAGE 19/28

(7)

特隔平9-5764

タ〜ンの一実施例を示す平面図である。

- 【図3】本発明による液晶表示基板の一実施例を示す断 面図である。
- [図4] 本発明による液晶表示基板の製造方法の一美施 例を示す一工程図である。
- 【図6】本発明による液晶表示基板の製造方法の一実施 例を示す一工程図である。
- 【図6】本発明による液晶表示基板の走査信号線に接続 されるペ子電極の一実施例を示す断面図である。
- される始子電極の一実施例を示す断面図である。
- 【図8】本発明による液品表示基板の基準電極として陽 極化成されたアルミニュウムを用いた場合の効果を示す グラフである。

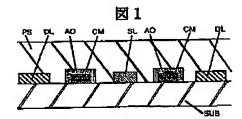
- *【図9】本発明による液晶表示基板の基準電極として陽 極化成されたタンタルを用いた場合の効果を示すグラフ である。
 - 【図10】本発明による液晶表示基板の他の実施例を示 す断面図である。
 - 【図11】本発明による液晶表示基板を組み込んだ液晶 表示装置の一実施例を示したブロック構成図である。
 - 【図12】本発明による液晶表示基板の他の実施例を示 ... す断面図である。
- 【図7】本発明による液晶表示基板の映像信号線に接続 10 【図13】本発明による液晶表示基板の他の実施例を示 す平面図である。

【符号の説明】

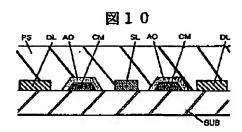
100……液晶表示基板、AO/GL……走查信号線、 SL······表示用電極、CT······基準電極。

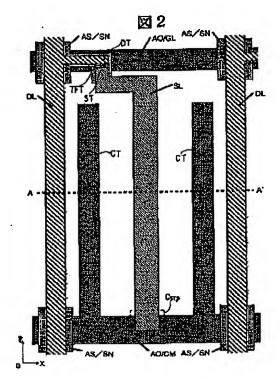
[図2]

(図1)



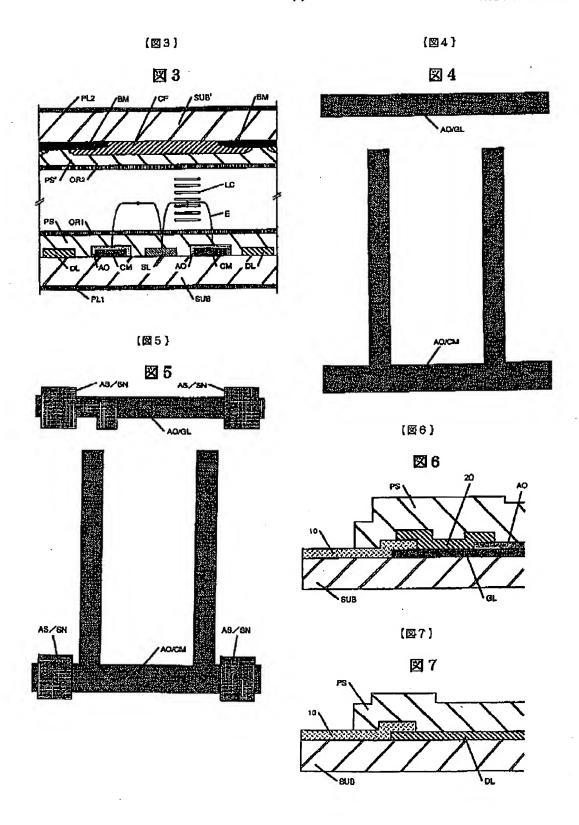
【図10】





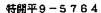
(8)

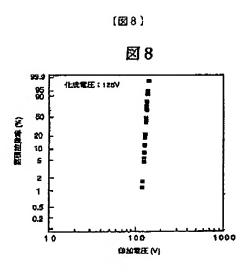
特開平9~5764

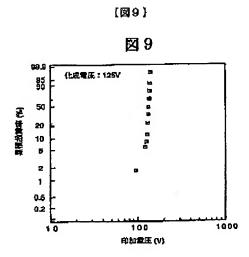


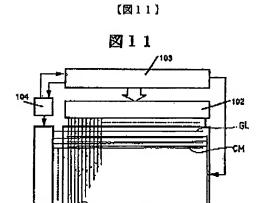
PAGE 22/28 * RCVD AT 10/18/2004 5:04:14 PM [Eastern Daylight Time] * SVR:USPTO-EFXRF-111 * DNIS:8729306 * CSID:202 496 7756 * DURATION (mm-ss):10-28

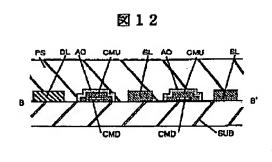










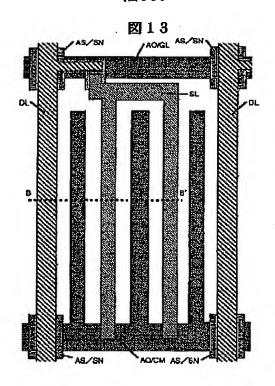


[图12]

100 (51B) (10)

特開平9-5764

(図13)



フロントページの続き

(72)発明者 芦沢 啓一郎 千葉県茂原市早野3300番地 株式会社日立 製作所電子デバイス事業部内 (72)発明者 篩内 雅弘 干薬県茂原市早野3300番地 株式会社日立 製作所電子デバイス事業部内

3 (4)

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

elects in the images include but are not immed to the items eneck	
☐ BLACK BORDERS	,
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES	
☐ FADED TEXT OR DRAWING	٠,
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING	
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES	
COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS	•
GRAY SCALE DOCUMENTS	
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT	•
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY	

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.